



TVS-10T 形

TEM ホルダー保管装置

高速ドライ自動排気 真空保管装置



- 本装置は TEM ホルダーをオイルフリー真空下で保管する装置です。
- 本装置を使用することにより、コンタミネーションの付着を大幅に減らすことが可能です。
- 高速全自動排気なので操作はボタン一つで完了です。
- TEM ホルダーポートはお客様のお使いの TEM ホルダーに合わせて製造いたします。
- ホルダー先端部が見られるガラス窓付き。

株式会社 真空デバイス

〒311-4155 茨城県水戸市飯島町 1285-5

TEL.029-212-7600 FAX.029-212-7601

URL : <https://www.shinkuu.co.jp>

E-mail : device@shinkuu.co.jp

仕様

- 排気系 : 20L/minダイヤフラムポンプ
67L/secターボ分子ポンプ
- 真空度測定: フルレンジ真空計
- 到達真空度: 5×10^{-4} Pa以下
- 装置サイズ: W360 × D290 × H360
(W寸法はTEMホルダーにより異なります)
- 電源 : AC100V 10A, アース線付3芯プラグ使用
- リーク用ガス: $\phi 1/4$ インチ swagelok 接続
(N₂パージ使用時最大圧力: 0.03MPa)
- 特別注文・改造につきましては、都度ご相談下さい。

オプション

ランプ加熱ユニット

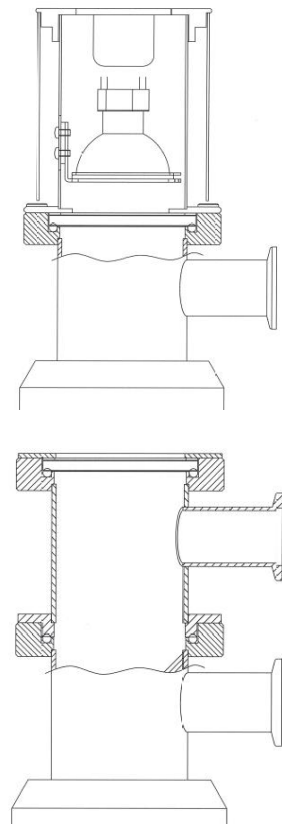
- ・ 加熱方式: 集光凹面鏡レンズ付ハロゲンランプによる加熱。
- ・ 放熱方式: ファンによる空冷放熱。
- ・ 温度制御: 熱電対测温PID制御、電子タイマースイッチ付。
- ・ 制御電源サイズ: 280 W × 450 D × 185 H

TEMホルダーポート追加

- ・ 真空保管するTEMホルダーを2本保有されている場合、ポート付きのチャンバーを追加することにより2本挿しが可能です。
- ・ チャンバーの取付は容易に行うことが可能です。

クライオホルダー用排気ユニット

- ・ クライオホルダー部を排気する機能を追加可能です。
- ・ 接続用変換継手は応相談で製作致します。



※ランプ加熱ユニットとTEMホルダーポート追加の併用では加熱機能に制限がございます。

本カタログ記載内容は、改良に伴い予告なしに変更する場合があります。ご了承下さい。